

I-line 曝光系統 考核項目表

一、 前置作業檢查

1. 機台是否可以作業.....
2. 機台溫度檢查.....
3. 機台水電氣檢查.....
4. 機台單元檢查
 - (1) Chamber.....
 - (2) Hg Lamp
 - (3) He-Ne Laser.....
 - (4) Stepper.....
 - (5) Work Station.....
5. 曝光平台歸位 & 晶圓載台清空.....

二、 光罩與光罩載入程序

1. 光罩放置光罩盒程序.....
2. 光罩資料檔載入與執行程序.....
3. 光罩載入後對準檢查 FRA.....
4. SRC 檢查執行與補值.....
5. 光罩載出與資料檔核對.....

三、 晶片放置與載入操作

1. 確認晶片放置晶舟方向.....
2. 晶片載入設定.....

四、 曝光程序載入與檢查

1. 曝光資料檔案載入設定.....
2. 晶片對準參數/片數/能量/焦距設定與檢查.....
3. 對準程序異常觀察與紀錄.....

五、 微影設備概念

1. 照明系統光源種類與影響.....
2. 投射鏡組功能與參數意義 (projection ratio/NA/ σ).....
3. 曝光平台原理與對準影響.....
4. 光罩成像機制.....

六、 其他

1. 關機程序.....
2. 限制晶片種類.....
3. 安全規定.....